

2510/02
2002065373



(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

162162

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2002年9月12日 (12.09.2002)

PCT

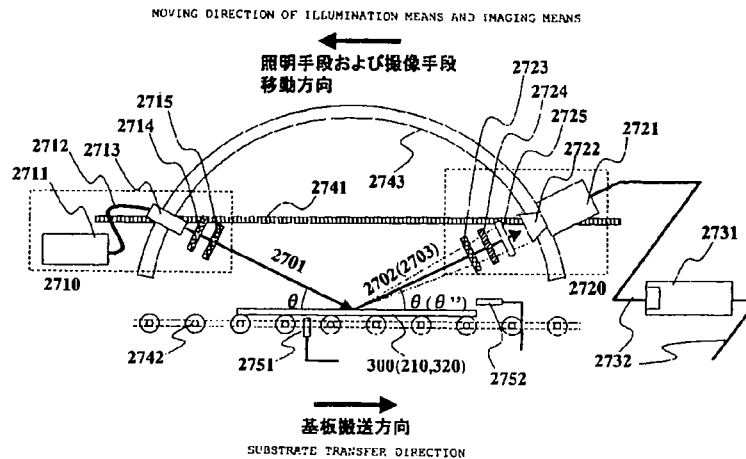
(10) 国際公開番号
WO 02/071023 A1

- (51) 国際特許分類⁷: G01M 11/00, G01N 21/956, H01J 9/42 (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 倉又 理 (KURAMATA, Osamu) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山 2 丁目 1 3 番 1 号 Shiga (JP). 佐々本 裕方 (SASAMOTO, Hiromichi) [JP/JP]; 〒607-8088 京都府 京都市 山科区 竹鼻 地藏寺南町 1 6-B 2 1 Kyoto (JP). 杉原 洋樹 (SUGIHARA, Hiroki) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山 2 丁目 1 3 番 1 号 Shiga (JP). 津田 敬治 (TSUDA, Keiji) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山 2 丁目 1 3 番 1 号 Shiga (JP).
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/01854
- (22) 国際出願日: 2002年2月28日 (28.02.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2001-61759 2001年3月6日 (06.03.2001) JP
特願2001-61760 2001年3月6日 (06.03.2001) JP
- (74) 代理人: 佐藤 謙二 (SATO, Kenji); 〒520-8558 滋賀県 大津市 園山 1 丁目 1 番 1 号 株式会社東レアイ・ピー・イー 滋賀支所内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, ID, JP, KR, SG, US.
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666 東京都中央区日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号 Tokyo (JP).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) Title: INSPECTION METHOD, INSPECTION DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD FOR DISPLAY PANEL

(54) 発明の名称: ディスプレイパネルの検査方法および検査装置ならびに製造方法



(57) Abstract: An inspection method, an inspection device, and a manufacturing method for display panel capable of manufacturing a high quality and highly reliable substrate by determining optimum optical conditions for the inspection of the surface shape of an inspected object by the structural characteristics thereof, accurately performing the inspection by reflecting the determined conditions on the inspection device to increase an yield rate without lowering a yield; the inspection device, comprising an illumination means, an imaging means, and a signal processing means; the inspection method, characterized by comprising the steps of measuring the signals of the bright and dark of a plurality of fluorescent substance layers while moving the substrate or the illumination means and imaging means in the direction of intersecting the fluorescent substance layers coated on the substrate at specified intervals and measuring a coated amount for each fluorescent substance layer by the obtained signals.

[続葉有]

WO 02/071023 A1



ACTION